

Q&A

Q1. イニシャル IQ ONE SQINシステムでの最大・最少の築盛量を教えてください。

ラスターペーストONE、スペクトラムステインとSQINを合わせた厚みが約0.2~最大0.6mmのマイクロレイヤリングに適した製品として設計しています。0.6mmを超える厚みで築盛する場合は、イニシャルLiSiやイニシャルZr-FSをお使いください。

レイヤー各層の厚み	平均厚み(min)	最大厚み(min)
ラスターペーストONE/ガムシェード	0.05	0.1
SQIN	0.1	0.5
合計	0.15	0.6

Q2. フォーム&テクスチャリキッドと通常のモデリングリキッドとの違いは何ですか？

SQIN専用のフォーム&テクスチャリキッドは、セラミックに独特のモデリング特性を発揮します。通常のリキッドよりも乾きにくく薄い層での築盛がしやすいように設計されています。

Q3. SQINは複数回焼成することはできますか？

複数回焼成可能です。2回目の焼成は温度を10°C下げで行います。最終の3回目の焼成は、2回目の焼成と同じ温度で行うことができます。

Q4. SQINで作製した修復物をさらにグレースまたはキャラクタライズすることはできますか？

可能です。イニシャルセラミックシステム全体の専用品であるラスターペーストONEとスペクトラムステインを使用し、SQINを焼成した温度と同じ温度で最終焼成します。

Q5. ジルコニアやニケイ酸リチウムのフレームワークにSQINを直接築盛できますか？

ジルコニアやニケイ酸リチウムのフレームにSQINを築盛する前に、ガラス質のコネクションレイヤーが必要です。ラスターペーストONEをフレームの表面全体に薄く塗布して焼成してください。

色調の補正が必要ない場合は、蛍光性のあるラスターペーストONE L-NFL、または歯肉部など蛍光性が不要ない場合はラスターペーストONE L-Nを使用します。

※コネクションファイヤリング焼成スケジュール

	予備加熱	乾燥時間	真空	昇温時間	焼成温度	保留時間
ニケイ酸リチウムガラスセラミック	450°C	4 min	Yes	45°C/min	760°C	1 min
ジルコニア	450°C	6 min	Yes	45°C/min	850°C	1 min

焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要です。上記は目安とお考えください。

ジーシー イニシャル IQ ラスターペースト ONE 管理医療機器 305AFBZX00066000
 ジーシー イニシャル スペクトラムステイン 管理医療機器 301AKBZX00012000
 ジーシー イニシャル IQ SQIN 管理医療機器 305AFBZX00063000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年09月現在のものです。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東 北 (022)207-3370 ●九 州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



GC



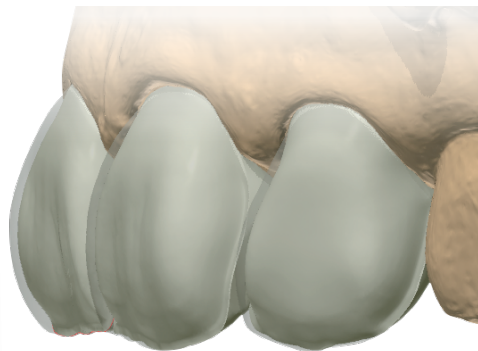
Since 1921
100 years of Quality in Dental



Create "NEW" world with GC Initial IQ ONE SQIN

時代に合わせて進化するイニシャルに、
マイクロレイヤリング専用のセラミックラインが誕生。

イニシャル IQ ONE SQIN (ワンスキン) はニケイ酸リチウムガラスセラミックスやジルコニアのフレームに非常に薄い層(約0.2~最大0.6mm)でのマイクロレイヤリングを行うことで、モノリシックの強度とレイヤリングの審美性の両立する新しいセラミックコンセプトです。



GC Initial IQ ONE SQIN 製品紹介

The paintable colour-and-form ceramic system

GC Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ SQIN

イニシャルIQ スキン

マイクロレイヤリング用に開発された非常に粒子の細かいセラミック パウダーです。ラスターペーストONEや、スペクトラムステインとの組み合わせで、約0.2~最大0.6mmの非常に薄い層でマイクロレイヤリングをすることが可能です。

※イニシャル IQ SQINはラスターペースト ONEや、スペクトラムステインと合わせた厚みが約0.2~最大0.6mmのマイクロレイヤリングに適した製品として設計しています。0.6mmを超える厚みで築盛する場合は、イニシャル LiSiやイニシャル Zr-Fsをお使いください。



Initial IQ Lustre Pastes ONE

イニシャルIQ ラスターペーストONE

通常のステイニングのように塗ることも、築盛のような立体的な表現も可能な内部・外部ステインに使用できるペーストステインです。歯冠色と歯肉色のラインナップがあり、幅広い熱膨張係数 (CTE) と焼成温度ですべてのイニシャル製品に使用できます。

initial™



Initial SpectrumStains

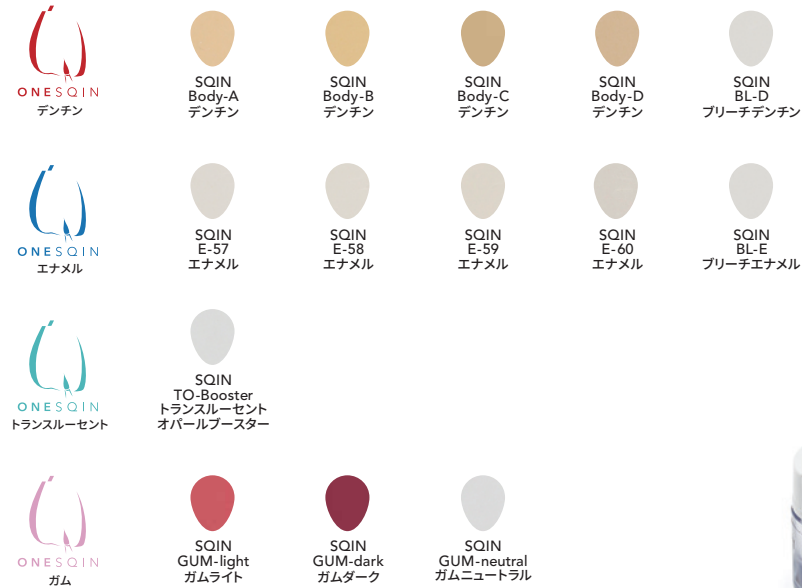
イニシャルスペクトラムステイン

幅広いセラミックスの内部・外部ステインに使用できるオールマイティなパウダーステインです。2種類のリキッドを使い分けることにより、粘稠度を調整し、表面のテクスチャーを残しながらステイニングが可能です。幅広い熱膨張係数に対応しておりラスターペーストONEなどに混ぜて使用することも可能です。

Initial IQ SQIN カラーチャート

イニシャル IQ SQIN

initial™



Initial IQ Lustre Pastes / ONE カラーチャート

イニシャル IQ ラスターペースト ONE



initial™



イニシャル IQ ラスターペースト (ガムシェード)



Initial SpectrumStains カラーチャート

イニシャル スペクトラムステイン

initial™



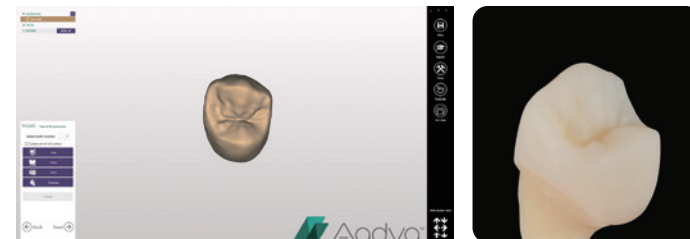
5

フレームワーク設計

initial™

モノリシックフレームワークの標準的な手順

ジルコニアまたは二ケイ酸リチウムガラスセラミックスのフレームは、各メーカーの指示に従い製作してください。フレームのカラーマネジメントは、重要な要素になります。最終補綴物に最も適したベースカラーと透光性を選択してください。



マイクロレイヤリングフレームワークの標準的な手順

マイクロレイヤリングタイプは、適切な築盛スペースの設計が必要です。約0.2mm～最大0.6mmのカットバック形態を付与してください。ジルコニアまたは二ケイ酸リチウムガラスセラミックスのフレームは、各メーカーの指示に従い製作してください。フレームのカラーマネジメントは、重要な要素になります。最終補綴物に最も適したベースカラーと透光性を選択してください。



6

モノリシッククラウンへのステイニング

Lustre Pastes ONEの基本的な使用方法

サンドブラスト処理された補綴物の全ての面にラスターペーストONEでステイニングをします。色調調整が必要のない部分はL-NまたはL-NFLでコーティングしてください。



	予備加熱	乾燥時間	真空	昇温時間	焼成温度	係留時間
ニケイ酸リチウム ガラスセラミックス	450°C	4 min	Yes	45°C/min	735-760°C ^(*)	1 min
ジルコニア	450°C	6 min	Yes	45°C/min	800-900°C	1 min

(*)イニシャルLiSiブロックの焼成温度: 730-750°C
LiSiブロックの場合、焼成によって色調が明るくなる場合があります。その場合はステインによる色調調整を行ってください。



注意: ラスターペーストONEは真空で焼成してください。焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要です。上記は目安とお考えください。

リキッドに関する注意

*initial*TM



ディルレーティングリキッド
各種ペーストの流動性を調整する希釈液です。ペーストの粘度が高い場合は、必要量のペーストをミキシングディッシュ等に出し、練和してください。

※ビンの中に直接入れないでください。



リフレッシュリキッド
ビンの中でペーストが乾燥してしまった場合に用いるリキッドです。ビンの中に直接滴下しても、必要量だけミキシングディッシュ等に出し練和しても使用可能です。

※よく振ってから、一滴入れるごとに流動性を確認しながら練和してください。

Point ラスターペーストのコツ

通常のステインのように薄めすぎると色ムラが起こる可能性がありますので、希釈しすぎないようにペーストがゲル状となる程度で塗布してください。色を薄めたい場合はL-Nと混ぜてご使用ください。



※ラスターペーストONEは、水と触れないように注意してください。色むらなどの原因になります。焼成後に足りない部分があれば同じ温度で追加焼成を行うことが可能です。

マイクロレイヤリング

Step 1 - フレームステイン & connection firing

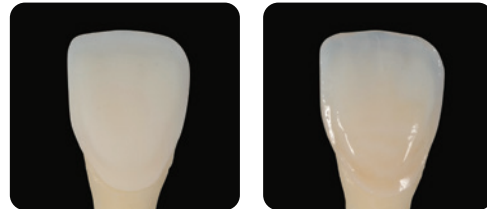
ラスターペーストONEでフレームの色調調整とコネクションレイヤリングを行います。

initial™



	予備加熱	乾燥時間	真空	昇温時間	焼成温度	係留時間
ニケイ酸リチウム ガラスセラミックス	450°C	4 min	Yes	45°C/min	760°C ^(*)	1 min
ジルコニア	450°C	6 min	Yes	45°C/min	850°C	1 min

(*)イニシャルLiSiブロックの焼成温度：740-750°C
LiSiブロックの場合、焼成によって色調が明るくなる場合があります。その場合はステインによる色調調整を行ってください。
※焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要ですので、上記は目安とお考えください。



注意：ラスターペーストONEは真空中で焼成します。必要な場合は、スペクトラムステインを使用し、同時に焼成することができます。ラスターペースト焼成後の面が滑って盛りにくい場合は、SQINを塗布する前に、50μmのアルミナサンドブラストを用い、低圧でサンドブラストし、表面をわずかに粗くすることも可能です。

Step 2 - イニシャル IQ SQINでのマイクロレイヤリング

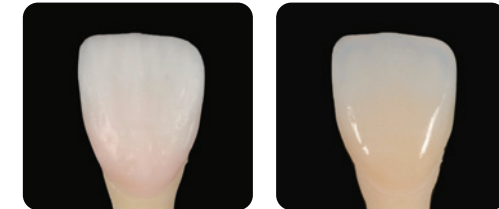
SQINパウダーをフォーム&テクスチャーリキッドを用いて練和し築盛します。

initial™



	予備加熱	乾燥時間 - 8 min		真空	昇温時間	焼成温度	係留時間
		Pre-drying time	Closing time				
ニケイ酸リチウム ガラスセラミックス	400°C	4 min	4 min	Yes	40°C/min	740-780°C ^(*)	1 min
ジルコニア	400°C	4 min	4 min	Yes	40°C/min	750-800°C	1 min

(*)イニシャルLiSiブロックの焼成温度：750-760°C
LiSiブロックの場合、焼成によって色調が明るくなる場合があります。その場合はステインによる色調調整を行ってください。
※焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要ですので、上記は目安とお考えください。



注意：乾燥工程は最低4分、クローズは4分の合わせて8分です。厚く築盛する場合は、乾燥時間を同じだけ長くする必要があります。焼成後、セルフグレース効果(光沢)が現れます。表面のテクスチャーと光沢の強さは、焼成温度と係留時間でコントロール可能です。焼成温度を10°C下げること、SQINを追加焼成することができます。追加焼成で、ラスターペーストONEやスペクトラムステインを焼成することも可能です。必要に応じて手研磨で仕上げることも可能です。